

准分子微纳加工系统

Excimer Micro-Machining System



Micromaster 为高性能准分子激光微纳加工系统；设计紧凑，功能强大，的全能型系统；人体工学设计典范。

主要特点

- 4~6ns 短脉冲 193nm, 300Hz(500Hz Optional)准分子冷激光，极低热效应累积，实现高质量紫外光子烧蚀；
- 专利的匀束光组，提供均匀的紫外激光能量分布；
- Relay Telescope 望远光路进一步匀化加工光束；
- 4~15 倍 PC 控制“连续可变”的投影光束缩倍设计提供方便灵活的投影控制；
- PC 控制 2x16,32 种掩模版选择；
- MRA 电动控制矩形可变光阑；
- MRA 与标准掩模版结合，由 PC 端软件组合生成虚拟掩膜；
- 紫外加工光路与加工监控光路实时齐焦的共焦设计，配合 Through The Lens 加工光路同轴视觉监控系统，提供 WYSIWYG——所见即所得的的加工光束聚焦模式；
- 1.5 微米光学分辨率；
- 提供 10J/cm² 的加工激光能量密度可以胜任高分子、金属薄膜、玻璃、陶瓷、金属.....材料的微纳加工
- 激光能量衰减：10~75%,100%;或 30~85%,100% 可选;调节步长 1%
- 通过 r/w 惯例程序,实现 0.05~0.5μm/Shot 加工深度控制；
- X,Y,Z,200x200x50mm 冲程，1μm 位移分辨率，电动控制位移台；
- 450 倍同轴变倍加工监控视觉+旁轴 40 倍加工导航监控视觉，兼顾加工细节与样本总体；双监视器显示；
- CE 认证
- Class 1 安全互锁

Micromachining



产品应用

- MEMS (微纳机械) 科研与工业
- 石英材料微纳加工，特种玻璃微纳加工
- 陶瓷材料微纳加工
- 金属薄膜微纳加工加工
- 高分子材料微纳加工

